

S8000G FIB-SEM 的优点

新一代镜筒内电子加速、减速技术，保证了复杂样品的低电压高分辨观测能力

首次配置的静电-电磁复合物镜，物镜无磁场外泄，实现磁性样品高分辨成像及分析

配置 4 个新一代探测器，可实现 9 种图像观测，对样品信息的采集更加全面

配置大型样品室，有超过 20 个扩展接口，为原位观测、分析创造了良好的工作环境

可以配置 TESCAN 自有或第三方的多种扩展分析附件，并独家实现与 TOF-SIMS、Raman 联用

新一代操作软件和自动功能，FIB 镜筒具有全自动的离子镜筒对中，极大简化了操作



新一代 Orage Ga FIB 镜筒，适用于各类具有挑战性的纳米加工任务

TESCAN S8000 配置了最新的 BrightBeam™ 镜筒，实现了无磁场超高分辨成像，可以最大化的实现各种分析，包括磁性样品的分析。新型镜筒中的电子光路设计增强了低能量电子成像分辨率，特别适合对电子束敏感样品和不导电样品的分析。创新的 Orage™ Ga FIB 镜筒配有最先进的离子枪和离子光学镜筒，使得 TESCAN S8000G 成为了世界顶级的样品制备和纳米图形成型的仪器。

S8000G 束流可达 100nA，具有超快速的加工能力，新颖的 SmartMill 高速切割功能，使得加工效率提升一倍。S8000G 离子能量最低可达 500eV，拥有更优秀的低压样品制备能力，可以快速制备无损超薄 TEM 样品。可以配置 TESCAN 自有或第三方的多种扩展分析附件，并独家实现与 TOF-SIMS、Raman 一体化。

新一代 OptiGIS 气体注入系统

S8000 可配置最新的多种探测器，包括透镜内 Axial detector 以及 Multidetector，可选择不同角度和不同能量来收集信号，体现更多种类的信息，同时获得更好的表面灵敏度和对比度。S8000G 有两种气体注入系统可供选择，标准的 5 针-GIS 和新一代 OptiGIS 单针-GIS，单针的 OptiGIS 支持通过更换气罐来更换化学气体，避免了以往多针气体注入系统样品仓内占用空间大的问题。

两种气体注入系统均可以选择多种沉积气体，其中 W、Pt、C 等用于导电材料沉积，SiO_x 用于绝缘材料沉积，XeF₂、H₂O 等用于增强刻蚀，或其它定制气体。

新一代 Essence 操作软件，更简单、高效的操作平台

S8000 可配置最新的多种探测器新操作软件极大简化了用户界面，能快速访问各主要功能，减少了繁琐的下单菜单操作，并优化了操作流程向导，易于学习，兼容多用户需求，可根据工作需要定制操作界面。新颖的样品舱内 3D 空间位置和移动轨迹模拟功能，可避免误操作，造成碰撞。



样品舱内的 3D 空间位置和移动轨迹模拟

集成多项创新性设计，拓展新应用领域的利器

S8000 可配置最新的多种探测器 S8000G 是 TESCAN 新一代 FIB-SEM 的首个成员，集成了 BrightBeam™ SEM 镜筒、Orage™ GaFIB 镜筒、OptiGIS 气体注入系统等多项创新设计，在高分辨能力、原位应用扩展能力和分析扩展能力方面达到了业内顶级水平，此外新一代操作流程和软件也给使用者带来更舒适、高效的体验。

上海百贺仪器科技有限公司
SHANGHAI BAHENS INSTRUMENTS CO., LTD.
规格外观如有变更，恕不另行通知



Tel.: 021-3358 7030 Fax.: 021-3358 9826
Service call: 400-099-6011
Http://www.bahens.com